

		イオンビーム・電子ビーム複合型精密加工分析装置 Helios 5 UX DualBeam (ThermoFisher Scientific)	直交型 FIB-SEM MI4000L (Hitachi High Technologies)	デュアルビーム FIB Quanta 3D 200i (ThermoFisher Scientific)
SEM	電子銃	モノクロメーター搭載ショットキー放出型	ショットキー放出型 (ZrO/W)	熱電子放出型 (W)
	加速電圧	0.35 kV - 30 kV	0.1 kV - 30 kV	0.5 kV - 30 kV
	検出器	インレンズ SE/BSE検出器 (TLD)	Upper SE 検出器	SE 検出器
		インカラム SE/BSE (ICD)	Lower SE	-
		インカラム BSE (MD)	EsB 検出器	-
		Everhart-Thornley SE検出器(ETD)	STEM 検出器	-
		二次イオン対応インチャンバー検出器(ICE)	-	-
散乱角選択BSE検出器(CBS/ABS)	-	-		
FIB	イオン源	Ga 液体金属イオン源	Ga 液体金属イオン源	Ga 液体金属イオン源
	加速電圧	0.5 - 30 kV	1 kV - 30 kV	2 kV - 30 kV
	最大ビーム電流	65 nA	90 nA	65 nA
FIB-SEM 幾何学配置		V字型 傾斜配置 (52 度)	L字型 直交配置 (90 度)	V字型 傾斜配置 (52 度)
ユーセントリックWD		4 mm	2 mm	15 mm
GIS		プラチナ, タングステン, カーボン	タングステン, カーボン	タングステン, カーボン
最大試料サイズ		φ150 mm, 高さ 55mm	4 x 4 x 2 mm	100 x 50 x 50 mm
マイクロプローブ		EasyLift	Kleindiek	Omni Probe
低加速イオン源		-	Ar	-
自動制御	TEM薄膜加工	AutoTEM 5	-	-
	連続断面加工3次元構築	Auto Slice & View 5	日立 Cut & See	-
	広領域連続撮影	MAPS 3	-	-
	Python制御	AutoScript 4	-	-
分析	XEDS 元素分析	-	Oxford X-Max ^N 150mm ² XEDS	-
	EBSD 結晶方位分析	Oxford Symmetry S3	-	-
クライオ システム		Thermo Scientific CryoMAT	日立 サイドエントリー クライオホルダー	Quorum Technologies PolarPrep 2000
大気非暴露		○	○	○
プラズマクリーナー		○	○	-